L18: Entry 19 of 41

File: JPAB

Mar 11, 1997

PUB-NO: JP409068514A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09068514 A

TITLE: MEASURING DEVICE FOR STREAMING POTENTIAL

PUBN-DATE: March 11, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUKUI, TOSHIBUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIMADZU CORP

APPL-NO: JP07248586

APPL-DATE: August 31, 1995

INT-CL (IPC): $\underline{G01} \ \underline{N} \ \underline{27/26}$

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To arrange a <u>filter</u> so as to be counter-washed by a flowing liquid in determining the <u>zeta potential</u> existing in the solid-liquid interface by the streaming potential measuring method, by precluding risk of dislocation in the E-P relation resulting from a pressure loss, determining the linear E-P relation, and enabling recording of the flowing liquid enabling recycling of the flowing liquid.

SOLUTION: A streaming potential measuring device concerned is configured with a measuring cell 1 for streaming potential, the first 3 and second vessel 4, and the first 5 and second 6 gas passages for feeding a pressurized gas. The arrangement further includes the first flowing liquid feeding/discharging passage 7, through which the flowing liquid 2 in the first vessel 3 is fed to the first flow port 12 of the measuring cell 1, and the second feeding/discharging passage 8 through which the flowing liquid 2 in the second vessel 4 is fed to the second flow port 12 of the measuring cell 1.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-68514

(43)公開日 平成9年(1997)3月11日

(51) Int.Cl.⁵ G01N 27/26

庁内整理番号 識別記号

FΙ

技術表示箇所

G01N 27/26

P

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平7-248586

平成7年(1995)8月31日

(71) 出願人 000001993

株式会社島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

(72)発明者 福井 俊文

京都市北区紫野西御所田町1番地 株式会

社島津製作所紫野工場内

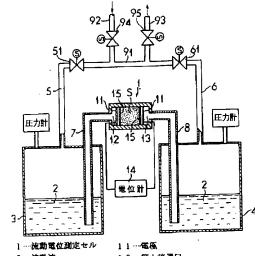
(74)代理人 弁理士 河▲崎▼ 眞樹

(54) 【発明の名称】 流動電位測定装置

(57)【要約】

【課題】 固-液界面に存在するゼータ電位を流動電位 測定法を用いて求めるときに、E-P関係に圧力損失に 起因するズレが生じないようにして、直線的なE-P関 係を求める。流動液のリサイクルを可能にする。フィル ターを用いる場合にフィルターが流動液によって逆洗さ れるようにする。

【解決手段】 流動電位測定セル1と、第1容器3およ び第2容器4と、加圧気体を送るための第1気体通路5 および第2気体通路6と、第1容器3の流動液2を流動 電位測定セル1の第1流通口12に送る第1流動液送排 通路7と、第2容器4の流動液2を流動電位測定セル1 の第2流通口13に送る第2流動液送排通路8と、を備 える。



2 …流動液

12…第1流通口

3 …第1容器 4 --- 第 2 容器 18…第2流通口 16…フィルター

5 …第1 気体選路

S --- 固体試料充填層

6 ---第2 気体通路

51、61、94、95…開閉パルブ

7 --- 第1流動液送排通路

8 --- 第 2 流動被送排通路

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体試料充填層を一対の電極で挟んでな る流動電位測定セルと、流動液を収容する耐圧気密構造 の第1容器および第2容器と、加圧気体を第1容器に導 入する第1気体通路および加圧気体を第2容器に導入す る第2気体通路と、第1容器内の流動液の液相部分と上 記流動電位測定セルの一側の第1流通口との間に亘って 配備された第1流動液送排通路と、第2容器内の流動液 の液相部分と上記流動電位測定セルの他側の第2流通口 えることを特徴とする流動電位測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、固一液界面の荷電*

ただし、ε:液体の誘電率

【0004】管の両端に圧力差Pを加え、その場合の液 体の移動速度をuとする(管壁においては移動速度は ※

 $F = 2\pi r \eta u / \delta$

 $q = \varepsilon \zeta / 4\pi \delta$

ただし、カ=液体の粘性係数

【0005】定常状態において、Fは加える圧力とつり★

$$2\pi r \eta u / \delta = P \pi r^2 / 1 \qquad \cdots (3)$$

(1)式および(3)式からるを消去して変形すると、

 $2\pi r \eta u q = P \varepsilon r^2 \zeta / 4 \eta 1$ \cdots (4)

(4)式の左辺は液の移動に伴う電流になる。そこで、 その誘起電圧をEとすれば、毛細管における電流iは ☆

 $i = (\pi r^2 \lambda / 1) E$

ただし、入:液の比導電率

 $\zeta = 4 \pi \eta \lambda E / \varepsilon P$

と呼ばれ、流動電位からゼータ電位を計算する場合に使 用される。

【0008】(6)式において、 $4\pi\eta\lambda/\epsilon$ は測定試 料に対して一定であるから、ゼータ電位(よ)は流動電 位(E)と圧力(P)の比に関係し、EとPは直線関係 となることがわかる。

【0009】以上の原理に基づいてゼータ電位を求める ために流動電位の測定を行うものとして流動電位測定装 置がある。流動電位測定装置は、その基本構成として、 固体試料充填層を一対の電極で挟んでなる流動電位測定 40 セルと、流動液を収容する容器と、加圧気体を上記容器 内に導入する気体通路と、上記容器内の流動液を流動電 位測定セルの固体試料充填層に送る流動液送出路と、を 備えており、容器内の流動液を流動液送出路を通して固 体試料充填層に押し流したときに電極間に発生する流動 電位を測定し得るようにしてある。

【0010】このような基本構成を備えた従来の流動電 位測定装置においては、流動液を収容している容器内の 空間に与える圧力を強制的に変化させることによって、 固体試料充填層を流動する流動液に圧力変化を生じさ *50 た。

* 状態を示すゼータ電位を求めるための流動電位測定装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】流動電位測定装置を使用する流動電位法 は、一対の電極間に固定試料を充填し、その固定試料充 垣層に流動液を通過させたときに電極間に発生する電位 差として規定される流動電位を測定することによりゼー 夕電位を求める方法であり、これは次のような原理に基 づいている。

との間に亘って配備された第2流動液送排通路と、を備 10 【0003】いま、1本の毛細管の管内に液を押し流す 場合を考える。このときの毛細管の半径をr、長さをl とする。また、電気二重層が管壁にあり、これを分子量 と考え、その厚さを δ 、電位差を ξ とすれば、単位面積 当たりの電荷 q は次の(1)式で与えられる。

 $\cdot \cdot \cdot (1)$

※ O . δの距離においては u)。このとき、単位軸長当り の内面の摩擦力Fは(2)式で与えられる。

 $\cdot \cdot \cdot (2)$

20★合っているから、

☆(5)式で与えられる。

 $\cdot \cdot \cdot (5)$

◆【0006】したがって、(4)および(5)式から、 $\cdot \cdot \cdot (6)$

【0007】(6)式は、Helmholz-Smoluchowskiの式 30 * せ、そのときに発生している流動電位を一対の電極で測 定することによってゼータ電位を求めるしかなかった。 たとえば、容器と気体圧力源との間の気体通路に開閉バ ルブと圧力調整バルブとを設け、まず開閉バルブを開い て容器内に気体を導入して容器内の流動液に一定圧を加 えて流動させ、その後、開閉バルブを開いた状態で圧力 調整バルブを少しずつ開いて流動液に対する付加圧力を 強制的に低下させていくという方法で容器内の空間に与 える圧力を変化させていた。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の ように理論的にはE/Pが一定、つまりE-P関係が直 線関係になるにもかかわらず、従来の流動電位測定装置 を用いて実際に測定してみると、試料によっては、ある いは同じ試料でも充填状態によってはE-P関係が曲線 関係になることがある。このため、測定者は、E-P関 係が直線関係になるように、測定中にモニターを行いな がら圧力調整バルブなどを操作するという苦労をし、し かも測定に熟練やノウハウを要するのみならず、測定者 によって測定結果にバラツキが生じるという問題があっ

【0012】また、容器内の流動液を使い捨てせざるを得なかったので、流動液を補充しなければならないという問題があった。

【0013】更に、固体試料に粉体が使われるときには、固体試料充填層と電極との間にフィルターを用いる必要があるが、そのような場合に、流動液は一方向にのみ通過するのでフィルターの目詰まりが顕著に起こることがあるという問題もあった。

【0014】ところで、流動液に対する付加圧力を強制的に変化させた場合、その流路の途中に固体試料充填層という抵抗があるために生じる圧力損失によって付加圧力と流動状態ひいては流動電位との間にズレを生じ、その結果、E-P関係が曲線関係として現れると考えられる。換言すると、モニターで監視している付加圧力と実際の液流動圧との間には、圧力損失分だけのズレが生じると考えられる。したがって、圧力を変化させる方法は、従来のように強制的でなく、流動時の圧力損失に合わせた形で行うのが好ましい。

【0015】この発明は、このような観点から、上記目的を達成すべくなされたものであり、圧力の変化が受動的に行われるような対策を講じることによって、EIP関係に圧力損失に起因するズレが生じないようになり、しかも流動液のリサイクルを可能として最少限の流動液での流動電位の測定を可能とし、さらに、フィルターを用いる場合にはそのフィルターに顕著な目詰まりが起こらないような流動電位測定装置を提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】請求項1に係る発明の流動電位測定装置は、固体試料充填層を一対の電極で挟んでなる流動電位測定セルと、流動液を収容する耐圧気密構造の第1容器および第2容器と、加圧気体を第2容器に導入する第2気体通路と、第1容器内の流動液の液相部分と上記流動電位測定セルの一側の第1流通口との間に亘って配備された第1流動液送排通路と、第2容器内の流動液の液相部分と上記流動電位測定セルの他側の第2流通口との間に亘って配備された第2流動液送排通路と、を備える、というものである。

【0017】このように構成された流動電位測定装置に 40 おいて、第1気体通路から加圧気体を第1容器に導入してその第1容器内の圧力を高めると、固体試料充填層の両端つまり第1流通口と第2流通口との圧力差に見合って、第1容器内の流動液が第1流動液送排通路を経て流動電位測定セルの第1流通口を通り、固体試料充填層を流動した後、流動電位測定セルの第2流通口から出て第2流動液送排通路を通り第2容器に回収される。このため、一対の電極により、固体試料充填層の両端つまり第1流通口と第2流通口との圧力差に応した流動電位が検出される。 50

【0018】ここで、第1容器には一定の圧力が加えられているのに対し、第2容器内の圧力は流動液の流入に伴って次第に上昇するので、結果として第1流通口と第2流通口との圧力差は受動的に変化し、流動液の流れに見合う圧力差になる。このため、E-P関係に圧力損失

に起因するズレが生じないようになる。 【0019】上記とは逆に第2気体通路から加圧気体を 第2容器に導入してその第2容器内の圧力を高めると、 第2流通口と第1流通口との圧力差に見合って、第2容 器内の流動液が第2流動液送排通路を経て流動電位測定 セルの第2流通口を通り、固体試料充填層を流動した 後、流動電位測定セルの第1流通口から出て第1流動液 送排通路を通り第1容器に回収される。この場合にも、 上述したところと同様に、一対の電極により、固体試料 充填層の両端つまり第2流通口と第1流通口との圧力差 に応じた流動電位が検出される。そして、第2容器には 一定の圧力が加えられているのに対し、第1容器内の圧 力は流動液の流入に伴って次第に上昇するので、結果と して第2流通口と第1流通口との圧力差は受動的に変化 し、流動液の流れに見合う圧力差になる。このため、E -P関係に圧力損失に起因するズレが生じないようにな

【0020】以上からわかるように、この流動電位測定装置では、第1容器と第2容器のうちのいずれか一方を流動液の供給側とし、他方をその回収側として機能させることができるので、流動液のリサイクルが可能になり最少限の流動液での流動電位の測定ができるようになる

【0021】また、測定操作を繰り返すごとに固体試料 充填層を通過する流動液の流れ方向が逆向きになるの で、固体試料充填層と電極との間にフィルターを介在し た場合にはそのフィルターに顕著な目詰まりが起こらな いようになる。

[0022]

【発明の実施の形態】図1はこの発明の実施の一形態である流動電位測定装置の説明図である。同図の流動電位測定装置は、固体試料充填層Sを一対の電極11,11で挟んでなる流動電位測定セル(以下「E測定セル」という)1と、流動液2を収容する耐圧気密構造の第1容器3および第2容器4と、加圧気体を第1容器3に導入する第1気体通路5および加圧気体を第2容器4に導入する第2気体通路6と、第1容器3内の流動液2の液相部分と上記流動電位測定セル1の一側の第1流通口12との間に亘って配備された第1流動液送排通路7と、第2容器4内の流動液2の液相部分と上記流動電位測定セル1の他側の第2流通口13との間に亘って配備された第2流動液送排通路8と、を備えている。

【0023】また、E測定セル1の一対の電極11.1 1には電位計14が接続されていると共に、固体試料充 50 填層Sと電極11,11との間には、その固体試料充填 層Sを保持するためにフィルター15が介在されている。他方、第1気体通路5や第2気体通路6は、開閉バルブ51,61を介して連通路91に接続されており、その連通路91に接続された2つの分岐路92.93のそれぞれに開閉バルブ94,95が介在されている。

【0024】この構成の流動電位測定装置による流動電位測定操作は次のようにして行われる。すなわち、最初に測定準備操作が行われる。この操作は、E測定セル1をセット後、開閉バルブ95,61を閉じた状態で開閉バルブ94,51を開き、第1気体通路5を通して第1容器3にN2 ガスのような加圧気体を送り込み、第1容器3の内圧を上昇させて流動液2を加圧する。こうすると、第1容器3内の流動液2が、第1流動液送排通路7、第1流通口12、固体試料充填層S、第2流通口13、第2流動液送排通路8をこの順に通って第2容器4に回収され、それらの内部の空気が流動液2によって置換される。この後、開閉バルブ94を閉じ、開閉バルブ95,61を開くと、第1容器3と第2容器4の内部空間が大気圧になり、流動液2の流動が停止する。以上で測定準備が完了する。

【0025】次に、第1容器3を流動液貯留容器、第2容器4を流動液回収容器として行う測定操作を説明する。

【0026】まず、開閉バルブ95,61を閉じ、開閉バルブ94,51を開いて、第1気体通路5を通して第1容器3にN2がスのような加圧気体を送り込み、第1容器3の内圧を上昇させて流動液2を加圧する。こうすると、第1容器3内の流動液2が、第1流動液送排通路7、第1流通口12、固体試料充填層S、第2流通口13、第2流動液送排通路8をこの順に通って第2容器4に回収される。このとき、固体試料充填層Sの両端の一対の電極11,11によって、第1流通口12と第2流通口13との間の圧力差に応じた流動電位が検出される。

【0027】ここで、第1容器3には一定の圧力が加えられているのに対し、第2容器4内の圧力は流動液2の流入に伴って次第に上昇するので、結果として第1流通口12と第2流通口13との圧力差が受動的に変化して流動液2の流れに見合う圧力差になる。このため、E-P関係に圧力損失に起因するズレが生じなくなり、直線40的なE-P関係が求められる。

【0028】測定は、放置しておくと第1容器3と第2容器4の内圧が等しくなるまで続行することができるが、通常は測定時間が長くなりすぎるため、適当なところで開閉バルブ94を閉じ、開閉バルブ95,51.61を開いて第1容器3と第2容器4の内圧を排圧することによって測定を終了する。

【0029】次に、第2容器4を流動液貯留容器、第1容器3を流動液回収容器として行う測定操作を説明する。

6

【0030】この操作では、まず、開閉バルブ95.5 1を閉じ、開閉バルブ94,61を開いて、第2気体通 路6を通して第2容器4にN2 ガスのような加圧気体を 送り込み、第2容器4の内圧を上昇させて流動液2を加 圧する。こうすると、第2容器4内の流動液2が、第2 流動液送排通路8、第2流通口13、固体試料充填層 S、第1流通口12、第1流動液送排通路7をこの順に 通って第1容器2に回収される。このとき、固体試料充 填層Sの両端の一対の電極11,11によって、第1流 通口12と第2流通口13との間の圧力差に応じた流動 電位が検出される。この場合、電位の符号が上記の場合 とは逆になることに注意を要するが、この点は、後のデ ータ処理にて補正をすればよい。この測定操作によって も、上記と同様に、第2流通口13と第1流通口12と の圧力差が受動的に変化して流動液2の流れに見合う圧 力差になるので、E-P関係に圧力損失に起因するズレ が生じなくなり、直線的なE-P関係が求められる。な お、測定に時間がかかりすぎることを防ぐためには、適 当なところで開閉バルブ94を閉じ、開閉バルブ95. 20 51,61を開いて第1容器3と第2容器4の内圧を排 圧することによって測定を終了すればよい。

【0031】以上説明した2種類の操作を繰り返すことによって、第1容器3や第2容器4に最初に入れた流動液2の量で何度でも測定が可能となる。そのため、流動液2が使い捨てされることなくリサイクルされるので、ローコストでの測定が可能となる。また、上述した2種類の操作では、フィルター15,15を通過する流動液2の流れ方向が互いに逆向きになるので、フィルター15,15が流動液によって逆洗されることになってその目詰まりが顕著に起こらないので、測定を繰り返しても個々の測定に長時間を要しない。この点に関し、フィルターに流動液を一方向からのみ通過させるような測定を繰り返し行うと、、そのうちにフィルターが目詰まりを起こし、流動液の流れが悪くなって測定に長時間を要するようになる。

【0032】ところで、流動電位を測定するような研究では、多くの場合、PHなどの流動液の物性を変化させて測定結果を評価することが行われるけれども、上記した第1容器3や第2容器4の一方、あるいは双方に、滴定装置を取り付け、パソコンなどで制御するようにすると、自動的に測定を行うことが可能になるので便利である。

[0033]

【発明の効果】請求項1に係る発明の流動電位測定装置によると、固体試料充填層で流動液を流動させたときに、固体試料充填層の両端つまり第1流通口と第2流通口との圧力差が受動的に変化して流動液の流れに見合う圧力差になるので、E-P関係に圧力損失に起因するズレが生じなくなって、そのE-P関係が直線関係になる50という効果がある。

【0034】また、流動液のリサイクルが可能になり最 少限の流動液での流動電位の測定を繰り返し行えるよう になるという効果や、測定操作を繰り返すごとに固体試 料充填層を通過する流動液の流れ方向が逆向きになるの で、固体試料充填層と電極との間にフィルターを介在し た場合にはそのフィルターに顕著な目詰まりが起こらな いようになるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施の一形態を示す流動電位測定装 置の説明図である。

【符号の説明】

S 固体試料充填層

1 流動電位測定セル

8

2 流動液

3 第1容器

4 第2容器

5 第1気体通路

6 第2気体通路

7 第1流動液送排通路

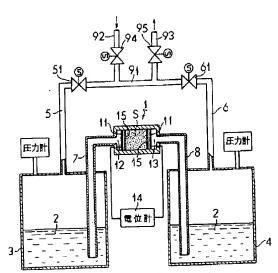
8 第2流動液送排通路

11 電極

12 第1流通口

13 第2流通口

【図1】



1 …流動電位測定セル

11…電極 12…第1流通口 2…流動液

3…第1容器

13…第2流通口

4…第2容器

15…フィルター

5 …第 1 気体通路

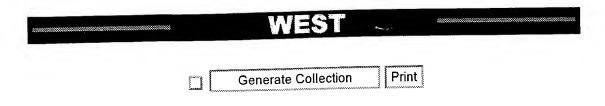
S --- 固体試料充填層

5 1 、 6 1 、 9 4 、 9 5 … 棚閉バルブ

6 …第2 気体通路

7 --- 第1流動液送排通路

8 …第 2 流動被送排通路



L18: Entry 3 of 41

File: JPAB

Feb 13, 2001

PUB-NO: JP02001038109A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001038109 A

TITLE: BACK WASHING METHOD IN FILTER DEVICE

PUBN-DATE: February 13, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

EBIE, KUNIO

MIYANOSHITA, TOMOAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

JAPAN ORGANO CO LTD

APPL-NO: JP11220109

APPL-DATE: August 3, 1999

INT-CL (IPC): $B01 ext{ D} ext{ } 24/46; ext{ } B01 ext{ D} ext{ } 29/62; ext{ } B01 ext{ D} ext{ } 24/48; ext{ } B01 ext{ D} ext{ } 29/60; ext{ } B01 ext{ D} ext{ } 36/04; ext{ } C02 ext{ } F$

1/28

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve characteristics of $\frac{\text{filtration}}{\text{back washing by intermittently performing the back washing, that is, by providing still standing time.}$

SOLUTION: When back washing a <u>filter</u> 24, a <u>zeta-potential</u> adjusting agent is added into back washing water from a flocculant storage tank 30. A quantity of the <u>zeta-potential</u> adjusting agent to be added is controlled particularly by <u>zeta-potential</u> of <u>filter</u> media of the <u>filter</u> 24 which is measured by a <u>zeta-potential</u> meter 38. As a result, the quantity of the <u>zeta-potential</u> adjusting agent to be stuck to a surface of the <u>filter</u> media by the back washing is properly controlled, capturing effect of the <u>flocculation</u> floc is improved and the good quality <u>filtered</u> water is obtained even direct after the back washing.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-38109 (P2001-38109A)

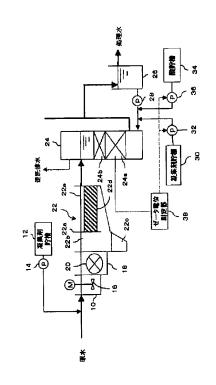
(43)公開日 平成13年2月13日(2001.2.13)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FI					テーマコード(参考)		
B01D	24/46			B 0	l D	23/24			Z	4 D 0 2 4
2012	29/62					36/04				4D041
	24/48			C 0 2	2 F	1/28			F	4 D 0 6 6
	29/60			В0	D	23/26			Z	
	36/04									
	·	1	李 查請求	未請求	請求	℟項の数 2	OL	(全	6 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顏平11-220109		(71)	出願.	人 00000	4400			
(олурцыя п	•	11101				オルカ	1ノ株式	会社		
(22)出顧日		平成11年8月3日(1999.8.3)	ı			東京都	江東区	新砂	1丁目2	2番8号
(==) p(a)()				(72)発	発明	者 海老江	[邦雄			
						北見市	東陵町	63番‡	2 30	
				(72)	発明	者 宮ノコ	友明			
					•	東京都	紅東区	新砂	1 丁目 2	2番8号 オルガ
						ノ株式	(会社内			
				(74)	代理	人 10007	5258			
						弁理:	ヒ 吉田	M	二 (タ	\$2名)
										最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ろ過装置における逆洗方法

(57)【要約】

【課題】 逆洗直後の、ろ過処理水の性状を改善する。 【解決手段】 ろ過器24の逆洗時には、逆洗水に凝集 剤貯槽30からゼータ電位調整剤を添加する。特に、こ のゼータ電位調整剤の添加量をゼータ電位測定器38に より測定したろ過器24のろ材のゼータ電位によって、 調整する。これによって、逆洗によりろ材表面に付着さ せるゼータ電位調整剤の量を適切なものにでき、凝集フ ロックの捕捉効果を改善して、逆洗直後においても良好 なろ過処理水を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 凝集剤を添加した凝集処理を行った後、 ろ過処理を行うろ過装置における逆洗方法において、 逆洗水の全量または一部にゼータ電位調整剤を添加して ろ過装置の逆洗を行うとともに、この逆洗水へのゼータ 電位調整剤の添加量をろ過装置のろ材のゼータ電位に基 づいて制御することを特徴とするろ過装置における逆洗 方法。

1

【請求項2】 凝集剤を添加した凝集処理を行った後、 ろ過処理を行うろ過装置における逆洗方法において、 逆洗水の全量または一部にゼータ電位調整剤を添加して ろ過装置の逆洗を行うとともに、このゼータ電位調整剤 を添加した逆洗水による逆洗の後に所定時間の静置工程 を含むことによって、ろ材と逆洗水中のゼータ電位調整 剤との接触を促進させることを特徴とするろ過装置にお ける逆洗方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、凝集剤を添加した 凝集処理を行った後、ろ過処理を行うろ過装置における 逆洗方法に関する。

[0002]

【従来の技術】河川水などを原水として浄水や工業用水を製造する場合や、排水処理等において、懸濁物質の分離のために凝集沈殿処理およびろ過処理が広く採用されている。すなわち、凝集沈殿処理では、まず原水に対しアルミ系の凝集剤等を添加混合して、原水中の懸濁物質を粗大フロック化する。そして、この粗大フロックを沈殿池に導入して沈殿処理することで、懸濁質の大部分を除去する。次に、この沈殿池で得られた上澄み水(凝集 30沈殿処理水)をろ過装置でさらに処理し、残留する微細懸濁物をさらに除去する。これによって、清澄な処理水を得ている。

【0003】このろ過装置において、ろ材が所定量の懸 濁質を捕捉すると、ろ過抵抗が上昇し、またフロックの 流出が大きくなるため、逆洗を行う。この逆洗は、逆洗 水(通常は処理水)をろ過装置に逆流させ、細くした懸 濁質を除去してろ材を再生することによって行う。

【0004】そして、この逆洗を行った直後において、 処理水中の懸濁物質(微細フロック)が増加し、十分な 40 ろ過が行えない場合が多い。

【0005】これは、通常のろ過処理においては、アルミ系の凝集剤を用いた場合は、ろ材の表面に薄く水酸化アルミニウムが付着し、これが微細な凝集フロックの除去に貢献しているが、逆洗によってこの付着物が除去されるため、逆洗直後の処理水が悪化するものと考えられる。

【0006】そこで、逆洗水に凝集剤を添加して逆洗を 行うことが提案されている。このような逆洗により、逆 洗の際に凝集剤がろ材中に供給され、ろ材表面のたとえ 50 間の静置工程を含むことによって、ろ材と逆洗水中のゼ

ば、水酸化アルミニウムの付着が助長される。従って、 逆洗直後においても、微細フロックの除去を十分なもの にできると考えられる。

2

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところが、この逆洗水に凝集剤を添加した場合においても、逆洗終了直後の処理水中の懸濁物質量はそれほど改善できないことがわかった。これは、逆洗時において、凝集剤を添加しても、この凝集剤をろ材全体に付着させることが難しいからである。すなわち、凝集剤ろ過層の下部(出口付近)において捕捉される確率が高く、従ってろ過層の下部のろ材にのみ上記付着物が形成されてしまう。また、洗浄排水中のアルミニウム濃度が上昇してしまうため、そのまま放流できないという問題もある。

【0008】また、逆洗直後に凝集剤の添加量を多くすることも考えられるが、この場合には、表面近くのろ材にのみに付着の形成が行われ、ろ材全体に付着物を形成することができない。そこで、ろ過直後において処理水の悪化を防げなかった。

【0009】さらに、最近では、クリプトスポリジウムなどの病原性原虫を除去する目的で、非常に精密なろ過が求めれらている。そこで、逆洗直後における懸濁物質の流出をさらに減少したいという要求もある。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、凝集剤を添加した凝集処理を行った後、ろ過処理を行うろ過装置における逆洗方法において、逆洗水の全量または一部にゼータ電位調整剤を添加してろ過装置の逆洗を行うとともに、この逆洗水へのゼータ電位調整剤の添加量をろ過装置のろ材のゼータ電位に基づいて制御することを特徴とする。

【0011】ろ材のゼータ電位は、添加したゼータ電位 調整剤によるろ材表面付着物の形成状態を示している。 そこで、このろ材のゼータ電位を所定値(例えば0~-10mV)に制御することによって、ろ材の表面状態を ろ過に好適なものに確実に調整することができる。本発 明に用いるゼータ電位調整剤は、ろ材表面に付着物が形 成されることにより、ゼータ電位が所定値に制御される ものであればどのようなものも使用可能で、アルミニム 塩や鉄塩等の凝集剤、高分子凝集剤等が用いられる。そ して、このようにろ材の表面に付着物を確実に形成する ことで、逆洗後のろ過において、当初より微細フロック の流出を防止して、良好な水質の処理水を得ることがで まる

【0012】また、本発明は、凝集剤を添加した凝集処理を行った後、ろ過処理を行うろ過装置における逆洗方法において、逆洗水の全量または一部にゼータ電位調整剤を添加してろ過装置の逆洗を行うとともに、このゼータ電位調整剤を添加した逆洗水による逆洗の後に所定時間の整置工程を全むことによって、み材と逆洗水中のゼ

一夕電位調整剤との接触を促進させることを特徴とす

【0013】このように、ゼータ電位調整剤を添加した 逆洗水による逆洗を行い、その後静置時間をおくという 間欠的な逆洗を行う。これによって、ゼータ電位調整剤 とろ材が十分混合するとともに、接触のための時間が得 られ、ろ材表面に例えば、水酸化アルミニウムの付着物 を効果的に形成でき、逆洗後のろ過において、当初より 微細フロックの流出を防止して、良好な水質の処理水を 得ることができる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態(以下 実施形態という)について、図面に基づいて説明する。 【0015】図1は、本実施形態に係る凝集分離装置の 全体構成を示す図である。河川水、湖沼水などの原水 は、まず混和槽10に流入される。この混和槽10に は、凝集剤貯槽12からの凝集剤が凝集剤ポンプ14に よって供給される。凝集剤は、PAC(ポリ塩化アルミ ニウム) などの無機アルミニウム凝集剤が好ましいが、 他の凝集剤であってもかまわない。そして、混和槽10 には、攪拌機16が設けられており、原水と凝集剤が急 速攪拌される。この混和槽10において、凝集剤が混和 された凝集剤混和水は、凝集槽18に流入する。この凝 集槽18には、緩速攪拌機20が配置されており、凝集 剤混和水が緩速攪拌され、凝集フロックの合体、粗大化 が図られる。

【0016】次に、凝集槽18からの緩速攪拌後の凝集 剤混和水は、傾斜板沈殿槽22に流入する。この傾斜板 沈殿槽22は、仕切板22aにより入口側と出口側に仕 切られており、入口側に槽深の深い沈殿部22bが形成 30 されている。そして、この沈殿部22bの下部は、沈殿 汚泥を貯留する汚泥貯留部分22cになっている。ま た、出口側には多数の傾斜板22dが配置されて傾斜板 沈殿部22eが形成されている。凝集剤混和水は沈殿部 22bに流入され、ここで沈殿処理された後、仕切板2 2aの下を通過して、傾斜板沈殿部22eを上向流で通 過する。そして、この傾斜板沈殿部22eの傾斜板22 dを通過する際にさらに沈殿処理がなされ、スラッジが 槽底へ向けて沈殿する。傾斜板沈殿部22eの槽底は、 るため、沈殿スラッジは重力により汚泥貯留部分22c に移動する。そして、傾斜板沈殿部22eを通過した上 澄みが傾斜板沈段槽22から排出される。なお、傾斜板 沈殿槽22の汚泥貯留部分22cに沈殿した汚泥は、適 宜引き抜かれ別途処分される。

【0017】このような凝集沈殿処理により、傾斜板沈 殿槽22からの沈殿処理水は、懸濁固形物のかなりの部 分は除去されたものになっている。この沈殿処理水は、 ろ過器24に流入される。このろ過器24は、アンスラ サイトのろ過層24bと、砂のろ過層24aの二層のろ 50 化するため酸の添加量も調整する。

過層を有する圧力式の急速ろ過器である。なお、場合に よっては、沈殿処理水に追加の凝集剤注入あるいは凝集 助剤注入を行いラインミキサーにて撹拌し、ろ過器24 に供給してもよく、またろ過器は重量式ろ過器であって もよい。

【0018】ろ過層24bのろ材としてアンスラサイト 以外のろ材を使用してもよいし、またこのろ過層24b 自体を省略してもよい。また、ろ過層24aについて、 砂に代えガーネットなどを利用したり、砂及びガーネッ トを多層とすることも好適である。

【0019】そして、このろ過器24のろ過処理水は、 処理水タンク26に貯留された後、配水される。

【0020】また、この処理水タンク26内の処理水 は、逆洗ポンプ28によりろ過器24の底部に供給でき るようになっている。そこで、ろ過器24に処理水を上 向流で供給し、ろ過器24内のろ過層を逆洗できるよう になっている。

【0021】すなわち、通水を継続していくと、次第に ろ過層に捕捉される懸濁物質が増加しろ材が飽和して、 ろ過器24はそれ以上懸濁物質を捕捉できなくなる。こ れは、ろ過抵抗の上昇や、処理水濁度の上昇等によって 確認できる。しかし、通常はろ材が完全に飽和する前 に、洗浄によりろ材の再生を行う。

【0022】また、洗浄のタイミングは、経験的に得ら れる時間に基づくタイマー設定や、差圧計によるろ過抵 抗の設定により行われる。さらに、逆洗は、ろ過水を用 いた逆流水洗浄や、逆流水洗浄に表面洗浄あるいは空気 洗浄を組み合わせて行われる。

【0023】ここで、この逆洗ポンプ28からろ過器2 4に至る逆洗水のラインには、凝集剤貯槽30から、ゼ ータ電位調整剤として、凝集剤が凝集剤ポンプ32によ り添加される。この凝集剤としては、上述の凝集剤貯槽 12と同様にPACなどが利用され、凝集剤貯槽12か らの凝集剤を添加するように構成してもよい。さらに、 酸貯槽34からの酸(酸性溶液、例えば硫酸)が酸ポン プ36によって添加されるように構成されている。

【0024】本実施形態において、ろ過器24における ろ過層24aのろ材についてのゼータ電位を検出するゼ ータ電位測定器38を有している。このゼータ電位測定 汚泥貯留部分22cに向けて深くなるように傾斜してい 40 器38は、ろ材を所定の上向流で重力の影響をうち消し た状態で、電気泳動により移動させてろ材のゼータ電位 を測定する。

【0025】そして、このゼータ電位測定器38は、測 定したろ材のゼータ電位に基づいて、ろ材のゼータ電位 が○~−10mVになるように凝集剤ポンプ32による 凝集剤の添加量および酸ポンプ36による酸の添加量を 制御する。すなわち、PACであれば、水酸化アルミニ ウムがろ材表面上に付着することで、ろ材のゼータ電位 が上昇する。また、酸の添加によってもゼータ電位が変

【0026】すなわち、ろ材のゼータ電位は、ろ材表面 への凝集剤(例えば、水酸化アルミニウム)の付着状態 を示している。そこで、このろ材のゼータ電位を所定値 (O~-10mV) に制御することによって、ろ材の表 面状態を微細フロックを捕捉しやすい状態に調整するこ とができる。そして、このようにろ材の表面に水酸化ア ルミニウムを確実に付着させることで、逆洗後のろ過に おいて、当初より微細フロックの流出を防止して、良好 な水質の処理水を得ることができる。

【0027】なお、ゼータ電位調整剤としてPACを用 10 いる場合において、逆洗水のpHは、5.5程度にする ことが、凝集剤による凝集、すなわち水酸化物によるろ 材表面の付着形成のために好ましい。そこで、酸ポンプ 36は、逆洗水のpHが5.5程度になるように制御 し、この状態でろ材のゼータ電位がO~-10mVの範 囲に収まるように凝集剤の添加量を制御することも好適 である。このためには、逆洗水または、逆洗排水のpH を計測し、酸添加量を制御することが好ましい。なお、 逆洗水のpHは、4.0~6.0程度の範囲で制御する ことが現実的である。

【0028】ここで、本実施形態では、次のような手順 で逆洗を行う。(i)まずろ過処理水をそのままで逆流 させる逆洗を行う。例えば、LV(空塔線速度)= 37 m/h×6分。(i i)次に凝集剤(例えばPAC)お よび酸を添加した逆洗水による逆洗を行う。LV=37 m/h×1分。(iii)次に、30秒静置状態で休止 する。(iv)次に凝集剤(例えばPAC)および酸を 添加した逆洗水による逆洗を行う。LV=37m/h× 1分。(v)次に、30秒静置状態で休止する。(v i) そして、ろ過処理水をそのままで逆流させる逆洗を 30 行う。例えば、LV(空塔線速度)= 3 7 m/h×1

【0029】このようにして、ゼータ電位調整剤として の凝集剤および酸を添加した逆洗水による逆洗を短時間 行い、その後休止時間をおくという間欠的な逆洗を行 う。これによって、凝集剤とろ材が十分混合するととも に、接触のための時間が得られ、ろ材表面に凝集剤(例 えば、水酸化アルミニウム)が十分に付着される。

【0030】「ゼータ電位の説明」上述のように、本実 施形態では、ろ材のゼータ電位が0~-10mVになる 40 ように逆洗水への凝集剤添加量を調整する。このゼータ 電位は、固体と液体の界面を横切って存在する電気的ポ テンシャルを示すものであり、水中の懸濁物質について の表面荷電を示す。通常、河川水等に含まれる懸濁物質 (粘度成分や藻類等)は負に帯電しており、懸濁物質が 各々負に帯電していることから電気的に反発し、凝集し にくい状態になっている。凝集剤は、この電位の中和を まず行い反発力を弱め、その後に集塊化つまり凝集を行 う。従って、凝集フロックのゼータ電位は中和点つまり ゼロに近い方が望ましい。通常、原水中の懸濁物質のゼ 50 注入した水逆洗を $LV = 3.7\,m/h \times 1.9$ 、休止3.0

6 ータ電位は-20mV以下で、凝集フロックのゼータ電 位は-10mV以上となっている。

【0031】ここで、浄水処理で一般に用いられる凝集 沈殿・急速ろ過法において、急速ろ過器より、特にろ過 開始直後に微小なフロックが流出することが知られてい る。この微小なフロックのゼータ電位は、-15mV以 下と低く、凝集が十分に行われていないことが知られて

【0032】ろ材も水中の懸濁物質と同様にそのままで は負に帯電しており、ろ材のゼータ電位を一10mV以 上にすることによって、ろ材表面への凝集剤水酸化物の 付着を十分なものにできる。そして、この付着物を形成 することで、フロックの捕捉能力を改善し、処理水中の 懸濁物質濃度の上昇を防止することができる。なお、ゼ ータ電位を0mV以上にするのは、経済的ではなく、ま た洗浄排水中のアルミニウム濃度が高くなるので、好ま しくない。

[0033]

【実施例】図1の装置を用いて実験を行った。

【0034】「実験条件」

·原水流量:23.6m3/d

·混和槽:滞留時間4分、G值250~400s-1

・沈殿池:上向流式傾斜板付き沈殿池、滞留時間40分、 上昇速度5cm/min

・ろ過器仕様:φ500mm×H4000mm(沪過面積0.196 m²) 、ろ層高700mm

- ろ過速度 (LV):5m/h (120m/d)

· ろ材:ケイ砂 比重2.5、有効径0.7mm、均等係数1.2

・通水時間:48時間(タイマーにより洗浄開始)

· 原水濁度:8~30度

· 原水pH: 7.5~8.2

· 凝集剤: PAC10~30mg/1

· 目標処理水濁度: 0.1度未満

「実験結果」濁度8度の原水に凝集剤としてPACを1 Omg/L添加し、pHを7.0に調整するために酸と して硫酸を加え、混和槽10にて攪拌機16を用いて混 和を行い、凝集槽18にて緩速撹拌を行い、傾斜板沈殿 槽(傾斜板無しでもよい)22にて沈殿処理を行った 後、ろ過器24に供給して処理水を得た。

【0035】ところで、ろ過器24は、ある程度通水を 行っていくと、濁質により沪材の間隙が飽和し、通水を 継続できなくなる。このろ過が継続できなくなるまでの 時間は、ろ過器流入水中の濁質濃度や通水速度などによ って異なり、通常は24~72時間程度であるが、本実 験では48時間毎に逆洗を行った。

【0036】この逆洗条件は、水逆洗をLV=37m/ h×6分、(i)PAC10mg/Lと75%硫酸を2 OmL/m³ 注入した水逆洗をLV=37m/h×1 分、休止30秒、(ii)75%硫酸を20mL/m³

秒、(i i i) 75%硫酸を20mL/m3 注入した水 逆洗をLV=37m/h×1分、とした。この時、PA Cと75%硫酸を注入した水のpHは5.5であった が、75%硫酸の注入率は、pHを4.0~6.0にす るよう注入することがPACの効果を高めるためには好 ましい。

【0037】また、PACと75%硫酸を注入した逆洗 を間欠的に行っているのは、無駄なくPACを沪材全体 に接触させるためである。間欠的に行うことにより、P い沪層内で効率よく、PACを全体に行き渡らせること ができる。

【0038】このような処理により、逆洗直後において も、処理水の悪化はなく、目標濁度を継続して維持でき ることが確認できた。

[0039]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 逆洗水へのゼータ電位調整剤の添加量をろ過装置のろ材 のゼータ電位に基づいて制御する。ろ材の表面にゼータ

電位調整剤が付着して、ろ材の表面状態をろ過に好適な ものにできる。そこで、逆洗後のろ過において、当初よ り微細フロックの流出を防止して、良好な水質の処理水 を得ることができる。

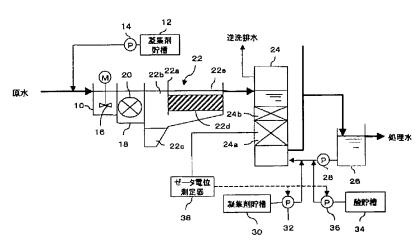
【0040】また、ゼータ電位調整剤を添加した逆洗水 による逆洗を行い、その後静止時間をおくという間欠的 な逆洗を行うことで、ゼータ電位調整剤とろ材が十分混 合するとともに、接触のための時間が得られ、ろ材表面 にゼータ電位調整剤の付着を確実なものとすることがで ACがろ材全体に拡散する時間が与えられ、撹拌力の弱 10 き、逆洗後のろ過において、当初より微細フロックの流 出を防止して、良好な水質の処理水を得ることができ

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施形態の装置の構成を示す図である。 【符号の説明】

10 混和槽、18 凝集槽、22 傾斜板沈殿槽、2 4 ろ過器、30 凝集剤貯槽、32 凝集剤ポンプ、 38 ゼータ電位測定器。

【図1】



フロントページの続き

C 0 2 F 1/28

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FI

テーマコード(参考)

Fターム(参考) 4D024 AA05 AB04 AB14 BA13 BB01

DA03 DA04 DA07 DB02 DB12

DB20 DB21

4D041 BA01 BA28 BB02 BB04 BB08

BB23 BC12 BC15 BC22 BD18

CB00

4D066 AA05 AA07 AB07 AC08 BB01

FA02